## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-123038

(43)Date of publication of application: 26.05.1988

(51)Int.Cl.

G03C 1/00 G03C 1/68

(21)Application number: 61-269291

(71)Applicant: NITTO ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing: 12.11.1986

(72)Inventor: KANEKO TOMOMICHI

## (54) IMAGE FORMING MATERIAL

### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the adhesion of a cured image to a substrate on which the image is formed, by forming an image forming photosensitive resin layer contg. a specified triphenylmethane compd. on a transparent support.

CONSTITUTION: A photosensitive resin layer contg. a compd. represented by formula I is formed on a transparent support and the unexposed part of the resin layer is removed by development with an alkaline aq. soln. The resin layer is made of a compsn. consisting of a film forming polymer, an ethylenic unsatd. polymerizable compd., a photopolymn. initiator and the compd. represented by the formula I. A styrene-maleic hemiester copolymer is preferably used as the film forming polymer and a compd. represented by formula II as the photopolymn. initiator. In the formulae I, II, R1 is methyl or ethyl, each of R2 and R4 is H, methyl or the like and R3 is H, Cl or the like. The adhesion of a cured image to the surface of a substrate on which the image is formed is improved, the swelling and stripping of the cured image by etching are prevented and a minute image can be formed.

$$(R_i)_{i,N} = \bigodot_{R_i}^{N(R_i)_{i,N}} = \bigcap_{R_i}^{N(R_i)_{i,N}} N(R_i)_{i,N}$$

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭63-123038

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)5月26日

G 03 C 1

1/00 1/68 3 1 1 3 3 1 7267-2H 7267-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

**②発明の名称** 画像形成材料

②特 願 昭61-269291

②出 願 昭61(1986)11月12日

四発明者 金子

母 道

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

社内

⑪出 願 人 日東電気工業株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

の代 理 人 弁理士 祢宜元 邦夫

OF 1878 12

1.発明の名称

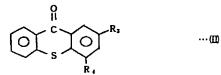
画 像 形 成 材 料

- 2.特許請求の範囲
  - (1) 透明支持体上に、つぎの式(1);

$$(R_1)_{z}N \longrightarrow O \longrightarrow C \longrightarrow C \longrightarrow N(R_1)_{z} \cdots (I)$$

(式中、R.はメチル茜またはエチル基、R.は 水素、メチル茜またはエチル基である) で表わされる化合物を含む感光性樹脂層を設けて なる画像形成材料。

(2) 感光性樹脂層が式(I)で表わされる化合物とともに皮膜形成性高分子物質とエチレン性不飽和 国合性化合物と光重合開始剤とを必須成分として 含むものであり、かつ光重合開始剤がつぎの式(II);



(式中、R₂は水菜、メチル基、エチル基、イソプロピル基または塩素、R₁は水素、メチル基または塩素、R₁は水素、メチル基またはエチル基である)

で扱わされる化合物を含む特許請求の範囲第⑴項 記載の画像形成材料。

- (3) 皮膜形成性高分子物質がスチレン-マレイン酸半エステル共置合体を含む特許請求の範囲第(2)項記載の画像形成材料。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

との発明は透明支持体上に感光性樹脂層を設け てなる画像形成材料に関する。

- 〔従来の技術〕

この種の画像形成材料は、画像を形成するべき 基板、たとえばガラス板やプラスチツクフィルム などからなる絶縁ペースにアルミニウム膜やITO

(2)

展(酸化インジウム-酸化スズ複合膜)などの専 電体層を形成してなる基板の上配導電体層の表面 に、感光性樹脂層が内側となるように加熱圧着し て積層し、この積層後所定の原面を介して透明支 持体側からパターン露光したのち、透明支持体の みを剝離した上で非露光部分の感光性樹脂層を現 像液で除去して現像することにより、基板上に露 光により硬化した感光性樹脂が画像として形成さ れる。

この現像後、上記非露光部分の除去によつて露出した導電体層をエッチング被にてエッチング除去するか、あるいはこの層上に適宜のメッキ液を用いてメッキ層を形成するなどの回路形成処理を行うことにより、 絶縁ベース上にパターン化 少年層が形成されてなる回路基板が得られる。ここで、前記露光により硬化した感光性樹脂層、つまり硬化画像は、上記の回路形成処理工程においてマスク材としての機能を果たし、この処理工程後は前記現像液よりも強力な試剤で除去される。

(3)

を形成するべき基板における導電体層の表面組さが2~5 μ程度と大きくされたものではこれと硬化画像との接着性をある程度満足して比較的良好な耐薬品性を示すが、液晶表示装置やエレクタロ路である事電体層の表面組さが1 μ以下となるような基板に対しては上記接着性が不足し、エッチングやメッキなどの回路形成処理工程中にで、メケングやメッキなどの回路形成処理工程中にでの機能を充分に発揮できなくなる場合があることが判った。

したがつて、この発明は、上記問題点を解消すること、つまり硬化画像の耐薬品性にすぐれて導電体層の表面粗さが1 四以下となるような基板に対しても精密な回路形成を行える画像形成材料を提供することを目的としている。

{ 問題点を解決するための手段 }

この発明者らは、上記目的を達成するために鋭 意検討した結果、各種の感光性樹脂中に従来用い られたことのない特定の化合物を含ませるように 従来、このような目的で用いられる随像形成材料としては、これより形成される硬化面像が基板(の母尾体層)との接着性にすぐれ、特にエッチング液やメッキ液などの薬品に抗してマスク材を耐楽の機能を充分に果たしうるようなすぐれた耐楽品性を増えたものであることが望まれ、この提案のほとんどは感光性樹脂を放されてきた。この提案のほとんどは感光性樹脂やに特定の添加剤を加えて的記接着性の改善を図ろうとしたものも知られている。

たとえば、特開昭 5 9 - 1 5 2 4 3 9 号公報などに、上記添加剤としてトリアジン誘導体を用いて、これと基板の導電体圏を構成する金属との間でメルカプチド型増体を形成させることによつて、硬化関像と基板との接着性を改善し、耐薬品性の向上を図ることが提案されている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかるに、この発明者らの実験検討によれば、 上記提案の如き従来公知の画像形成材料は、画像

(4)

したときには、導電体層の表面粗さが1 m以下となるような基板に対してもこれと硬化圏像との接着性にすぐれてマスク材としての機能を充分に発揮できる、したがつて精密な回路形成が可能となる画像形成材料が得られるものであることを知り、この発明を完成するに至った。

すなわち、との発明は、透明支持体上に、つぎ の式(I):

$$(R_1)_{2N} \xrightarrow{R_2} C \xrightarrow{R_3} N(R_1)_{2} \cdots (I)$$

$$R_2 \xrightarrow{R_3} R_3 \xrightarrow{R_3} N(R_1)_{2} \cdots (I)$$

(式中、R1はメチル基またはエチル基、R2は 水泵、メチル基またはエチル基である) で表わされる化合物を含む感光性樹脂層を設けて なる画像形成材料に係るものである。

[発明の構成・作用]

との発明において使用する前記式(I)で安わされる化合物は、共存するラジカルと反応して発色す

るトリフェニルメタン系染料の一種であり、上記ラジカルとの反応性がフェニル基に導入された特定の置換基に起因して非常に大きいるとから、感光性樹脂層を露光に反応して中間体を生成する。この発明では、この光明では、この発明では、この発明では、必要電体層との接着性が大きく、改良されるものであるが、この理由はおそらく上記中間体の生成に基づくものであると推定される。しかし、その詳細については必ずしも明らかとはいえない。

このような化合物の具体例としては、4・4・4・4・2 - メチリディンートリス(N・Nージメチルペンピソアミン)、4・4・4・4 - メチリディンートリス(N・Nージエチルペンゼンアミン)、4・4・4 - メチリディンートリス(N・Nージメチルー 3 - メチルペンゼンアミン)、4・4・4 - メチリディンセントリス(N・Nージエチルー 3 - メチルペンゼンアミン)、4・4・4 - メチリディン・トリス(N・Nージエチルー 3 - メチルペンゼンアミン)、1・Nージメチルー 3 - エチルペンゼンアミン)、

(7)

質全体の 5 0 重量 % 以下となる割合で併用するのが望ましい。

上記のスチレン・マレイン酸半エステル共重合体を構成するマレイン酸半エステルとは、無水マレイン酸にイソプロピルアルコール、ブチルセロソルブなどの炭素数が通常3~6程度のアルコール類を反応させて、分子内に発離のカルポキシル基が1個残存する半エステルとしたものである。この半エステルとスチレンとの共重合割合は、共重合体中上記半エステルが40~80重量光程度を占める割合であるのが望ましい。

このようなスチレン・マレイン酸半エステル共 国合体の分子量としては、重量平均分子量が5万 ~13万の範囲にあるのが好適である。分子量が 低くなりすぎると、皮膜形成性が悪くなるほか、 既光硬化部分の現像被(アルカリ性水溶液)や ッチング液などに対する耐性に劣るため、現像性 の低下や耐薬品性の低下をきたしやすい。また 分子量が高くなりすぎると、非蹊光部分を現像性 で除去する際の除去性に劣るため、やはり現像性 4・4・4-メチリデインートリス(N・N-ジェ チル-3-エチルベンゼンアミン)などがある。

との発明において上記の化合物を含ませるべき 感光性樹脂層の種類は限定されず、従来公知のも のを広く適用できる。これらの中でも特に一般的 なものとしては、露光により重合硬化するタイプ のものがあり、その代表例は皮膜形成性高分子物 質とエチレン性不飽和重合性化合物と光重合開始 剤とが必須成分として含まれてなるものである。 以下、この重合硬化タイプのものを例にとり、そ の材料構成などに関しさらに詳しく説明する。

上記の皮膜形成性高分子物質としては、非露光 部分の感光性樹脂層を除去してアルカリ性水溶を 形成するための現像液としてアルカリ性水溶を 用いる場合は、特にスチレンーマレイン酸半な テル共重合体をこれ単独で用いるか、あるいはま テル共重合体をこれ単独で用いるか、まるいまま ロメチルメタクリレートの部分加水分解物、共ま 合ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリク にプレン、スチレンーブタジェン共重合ゴムなどの の他のポリマーとこれら他のポリマーが高分子物

(8)

の低下をきたしやすい。

このような皮膜形成性高分子物質と併用するエチレン性不飽和重合性化合物としては、エチレン性不飽和結合を1個有する化合物と2個以上有する化合物とが包含され、現像液として何を用いるかにより前記皮膜形成性高分子物質との組み合わ

せを考慮して適宜のものを使用する。

エチレン性不飽和結合を1個有する化合物としては、たとえばアクリル酸ないしアクリル酸エステル類、メタクリルではいしメタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物類、ピニルエーテル類、ピニルエステル類、N-ビニル化合物、スチレン類、クロトン酸エステル類などがある。

ここで、アクリル酸エステル類の具体例としては、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチルへキシル、アクリル酸オクチルなどのアクリル酸アルキルエステルがあり、またメタクリル酸エステル類の具体例としては、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸インプロピルなどのメタクリル酸アルキルエステルが挙げられる。

アクリルアミド類としては、アクリルアミドの ほか、N-メチルアクリルアミド、N-エチルア クリルアミド、N-ブチルアクリルアミド、N-

(11)

れ、スチレン類としては、スチレンのほか、メチルスチレン、クロルメチル化スチレン、アルコキシスチレン、ハロゲン化スチレン、安良香酸スチレンなどがある。さらにクロトン酸エステル類としては、クロトン酸メチル、クロトン酸ブチル、クロトン酸ハキシル、クロトン酸イソプロピルなどが挙げられる。

エチレン性不飽和結合を2個以上有する化合物は、前記エチレン性不飽和結合を1個内に個対な化合物は、りもより好なしく使用される。これに風酸ないしょタクリル酸とのエステル類があり、メタクリンないしてカリレートが用いられる。上に多価アルコールでリンートがリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリエチャンでリコール、ポリント・リンティン・ドックロール、オリンティンがリコール、パンティン・ドックエリスリトール、ジベンタエリスリトール、ジベンクエリスリトール、ジベンクエリスリトール、ジャルを記載を表現しています。

イソプロピルアクリルアミド、N-t-ブチルアクリルアミド、N-エチルヘキシルアクリルアミドなどのN-アルキルアクリルアミドなどがある。メタクリルアミド類としては、メタクリルアミドのほか、N-メチルメタクリルアミド、N-エチルメタクリルアミド、N-t-ブチルメタクリルアミド、N-t-ブチルメタクリルアミド、N-t-ブチルメタクリルアミド、N-t-アルトルメタクリルアミドなどが挙げられる。

アリル化合物類としては、酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリルなどのアリルエステルがあり、またビニルエーテル類としては、ヘキシルビニルエーテル、ギシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテルなどのアルキルビニルエーテルが挙げられる。

また、ビニルエステル類としては、ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルパレレート、ビニルカプロエートなどが挙げら

62

タン、ソルビトール、1・4 - ブタンジオール、 1・2・4 - ブタントリオール、 2 - ブテン - 1・4 - ジオール、 2 - ブテンー1・4 - ジオール、 2 - ブテンー1・4 - ジオール、 2 - ブテンー1・4 - ジオール、1・3 - ブロパンジオール、トリエタノールアミン、デカリンジオール、 3 - クロルー1・2 - プロパンジオールなどがある。

上記以外のポリエチレン性不飽和重合性化合物として、アクリル酸ないしメタクリル酸、多価アルコールおよび多塩基性酸から合成されるようなポリエステルアクリレート類ないしポリエステルメタクリレート類や、ピスフエノールにエチレンオキサイドやプロピレンオキサイドを付加反応でせるととにより得られるジ(メタ)アクリレート類なども使用できる。

上述したような各種のエチレン性不飽和度合性 化合物は、前配の皮膜形成性高分子物質100重 量部に対して通常10~300重量部、好ましく は50~200重量部の割合で使用するのがよい。

64

との使用量が過少でもまた過多でも現像性や耐薬 品性にすぐれる感光性樹脂層の形成が難しくなる ため、好ましくない。

つぎに、光重合開始剤としては、カルポニル化合物、有機磁費化合物、過酸化物、レドックス系化合物、アゾおよびジアゾ化合物、ハロゲン化合物、チオキサントン系化合物などがある。とれらの中でも特に好速なものは、下記の式(III):

(式中、R』は水素、メチル基、エチル基、イソプロピル基または塩素、R』は水素、メチル基または塩素、R」は水素、メチル基またはエチル基である)

で表わされるチオキサントン系化合物である。

上記のチオキサントン系化合物のうち最も好適な例としては、上記式⑪中のR<sub>3</sub>,R<sub>4</sub>が共に水業であるチオキサントン、共にメチル苺である2・4-ジメチルチオキサントン、共にエチル苺である2

(15)

キノン、2-t-ブチルアントラキノン、9·10
-フェナントレンキノン、ジアセチル、ペンジルなどがある。また、有機硫黄化合物としては、ジブチルジスルフイド、ジオクチルジスルフイド、ジベンジルジスルフイド、ジフエニルジスルフイド、ジベンゾイルジスルフイド、ジアセチルジスルフィドなどがある。

過酸化物としては、過酸化水素、ジー t ーブチルペルオキシド、過酸化ペンゾイル、メチルエチルケトンペルオキシドなどが挙げられる。さらに、レドックス系化合物は、過酸化物と還元剤との組合せからなるものであり、第一鉄イオンと過酸化水素、第一鉄イオンと過硫酸イオン、第二鉄イオンと過酸化物などがある。

アソおよびジアソ化合物としては、α・α-アソ ピスイソプチロニトリル、2-アソピス-2-メ チルプチロニトリル、1-アソピス-シクロヘキ サンカルポニトリル、p-アミノジフェニルアミ ンのジアゾニウム塩などがある。ハロゲン化合物 としては、クロルメチルナフチルクロリド、フェ ・4 - ジェチルチオキサントン、R1が塩素でR1が水素である2 - クロルチオキサントン、R1がイソプロピル番でR1が水素である2 - イソプロピルチオキサントンなどが挙げられる。これらのチオキサントン系化合物はこれより発生するラジカルが節記式(I)で表わされる化合物と反応しやすく、この反応により生成する中間体が硬化圏像と基板の磁体層との接着力の向上に大きく有している。なお、このようなチオキサントン系化合物とともにアージメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル、アージメチルアミノ安息香酸エチルエステルなどを併用してもよい。

チオキサントン系化合物以外の光重合開始剤として使用しうる前記カルポニル化合物などの具体例につき挙げれば、まずカルポニル化合物としては、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインプテルエーテル、ベンジルジメチルケタール、ベンゾフエノン、アントラキノン、2-メチルアントラ

80

ナシルクロリド、クロルアセトン、β-ナフタレンスルホニルクロリド、キシレンスルホニルクロリド、キシレンスルホニルクロリドなどを挙げることができる。

これらの光重合開始剤は、その一種を用いてもよいし二種以上を混合して用いてもよい。使用量は、エチレン性不飽和重合性化合物100重量部に対して通常0.5~20重量部、好適には5~10重量部の範囲とすればよい。 透少では感光性樹脂層の露光硬化性に劣り、また所定量を超えて用いてもそれ以上の硬化性の向上は認められないため経済的に不利である。

歴光により重合硬化するタイプの感光性樹脂層は、以上の皮膜形成性高分子物質とエチレン性不飽和重合性化合物と光重合開始剤とを必須成分とし、これに前記の式(I)で表わされる化合物を含ませた光重合性組成物からなるものであるが、この組成物中の上記式(I)で表わされる化合物の含有量としては上配光重合開始剤100重量部に対して10~500重量部、好適には50~300重量部となるようにするのがよく、組成物全体中に占

める割合としては通常 0.1~10 宜量 %程度であるのが好適である。

なお、上配の光重合性組成物中には必要に応じて 熱重合禁止剤や着色剤を配合するようにしても よく、さらに望むなら可塑剤、接着促進剤などの 各額添加剤を配合することも可能である。

熱重合禁止剤としては、パラメトキシフェノール、ヒドロキノン、アルキル基またはアリール基ではアリール、塩換ヒドロキノン、セーブチルカテコール、ピロガロール、塩化第一鍋、フェノチアジン、クロラニール、ナフチルアミン、βーナフトール、2・6ージーレーブチルー pークレゾール、ピリジン、ニトロペンゼン、ジニトロペンゼン、ロートルイジン、メチレンブルー、酢酸銅の如き有機酸などがある。これらの熱重合禁止剤はエチレン性不飽和重合性化合物100重量部に対して通常0.001~5重量部の範囲で用いられる。

着色剤としては、たとえばカーポンプラック、 酸化鉄、フタロシアニン系顔料、アゾ系顔料など の顔料や、メチレンプルー、クリスタルパイオレ

09

どが挙げられる。

一方、上記の選明支持体としては、この上に均一厚みの感光性樹脂層を形成しうるように、 表面 平滑性にすぐれたものであることが望まれ、 また 度光後現像するにあたって上記層から容易に 知能 しうるように、その材質を選択しまた安面処理を 施していないものを使用することが望まれる。 さらに、 第光によって 磁光性樹脂層を良好に光重合できるように、 光の透過性にすぐれていること たとえば 被長 類田 2 9 0 ~ 5 0 0 nm において 光の透過率が 3 0 %以上、特に好適には 6 5 %以上となるものであることが要求される。

このような要求特性を満足する透明支持体には、種々のものがあるが、その代表的な例を挙げれば、たとえば厚みが5~100四、特に10~30四程度のポリエチレンテレフタレートフイルム、ポリエチレンフイルム、ポリプロピレンフイルムなどがあり、これらの中でもポリエチレンテレフタレートフィルムが最も好ましい。

との発明の画像形成材料はロール状に稳固し、

ット、ローダミンB、アクシン、オーラミン、ア ゾ系染料、アントラキノン系染料などの染料があるが、光重合開始剤の吸収液長の光を吸収しない ものが好ましい。着色剤の添加量は、皮膜形成性 高分子物質およびエチレン性不飽和重合性化合物 の合計量100重量部に対して通常0.01~5重 量部の範囲で用いられる。

この発明においては、このような光重合性組成物を通常溶媒に均一に溶解し、これを透明支持体上にキャスティングしたのち、乾燥することにより、一般に5~100㎡、特に好適には10~50㎡程度の厚みの感光性樹脂層を形成して、画像形成材料とする。

上記の溶媒としては、光盤合性組成物を溶解し うるものであれば特に限定されず、一種であつて も二種以上の混合溶媒であつてもよい。具体例と しては、アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソブチルケトン、メチルセロソルブ、エチルセ ロソルブ、酢酸エチル、酢酸ブチル、ジクロルメ タン、クロロホルム、メタノール、エタノールな

(20)

あるいは層状に重ね合わせて保存することができるが、その際材料相互の粘着を防止するために、 感光性樹脂層を形成してなる透明支持体の背面に シリコーン樹脂などの離型剤で離型処理を施すか、 あるいは離型効果のある保護フイルム、たとえば ポリエチレンフイルム、ポリプロピレンフイルム、 ポリテトラフルオロエチレンフイルムなどを感光 性樹脂層上に貼り合わせておくのがよい。上記の 保護フイルムは感光性樹脂層の経時的な劣化を防止するのにも役立つものである。

この発明の画像形成材料を用いて所定パターンの画像を形成するには、従来公知の方法に準じて行えばよい。すなわち、まず、画像を形成するべき基板、たとえばガラス板やプラスチックフィルムなどからなる絶縁ベースにITO膜やアルミニウム膜などの導電体層を形成してなる基板の上記導電体層の表面に、画像形成材料を、保護フィルムを有するときはこれを剝離したのち、感光性樹脂層側が内側となるように通常90~130℃の条件で加熱圧着して積層する。

ついで、この積層体の透明支持体例から原圖を 通して活性光線をパターン露光する。活性光線と しては、200~700mm、好適には250~ 500mmの紫外線ないし可視光線があり、これ らに好適な光球としては、低圧・高圧・超高圧の 水銀ランプ、キセノンランプ、カーボンアーク燈、 ハロゲンランプ、殺菌燈などがある。

上記の現像被としては、感光性樹脂層の材料構成に応じてアルカリ性水溶液かあるいは有機溶剤を主とした被が用いられる。このうち、特化好ましいものはアルカリ性水溶液であり、皮膜形成性高分子物質が前記したスチレンーマレイン酸半エステル共宜合体などである場合の上記アルカリ性

(23)

被にてエッチング除去する回路形成処理を行う。 との処理は、たとえばエッチング液として塩酸・ 水:硝酸の容積比が1:1:0.08となる塩酸ー 硝酸混合水溶液を用いて、この液中に前配画像を 成された基板を30~120秒間揺動浸液すると はなどによって行える。また、エッチング液として りん酸:硝酸:酢酸:水の容積比が20:1: 0.5:7となる混合水溶液を用いて上記同様に 型してもよい。なお、上記エッチング処理の代わ りに、既知のメッキ液を用いて酵出した導電体層 上にメッキ層を形成することもある。

このような種々の回路形成処理工程において、 硬化画像はエッチング液やメッキ液などの薬品に 対して充分な耐性を示し、マスク材としての機能 をいかんなく発揮する。特に、この機能は、画像 を形成するべき基板における導理体層の姿面粗さ には関係なく、つまりこの姿面粗さが1 一以下通 常0.01 一までであつても、発揮される。

るの回路形成処理後、硬化画像を前記現像被よ りも強力な試剤、たとえば現像被が前記したアル 水溶液につきさらに詳しく述べれば以下のとおりである。

アルカリ成分としては、リチウム、ナトリウム またはカリウムの水酸化物からなる水酸化アルカ り、リチウム、ナトリウムまたはカリウムの炭酸 塩や重炭酸塩の如き炭酸アルカリ、リン酸カリウ ムやリン酸ナトリウムなどのアルカリ金属リン酸 塩、ピロリン酸ナトリウムやピロリン酸カリウム などのアルカリ金属ピロリン酸塩などが用いられ、 これらの中でも特に炭酸ナトリウムが好適である。 アルカリ成分の決度は、水溶液中 0.5~3 重量% 程度であり、これより高くなると露光部分までも が一部除去されるおそれがあるため現像性が悪く なる。現像時の温度は、感光性樹脂層の各構成成 分の種類に応じて適宜調節されるが、一般には20 ~30℃程度である。なお、上記の現像液には、 必要に応じて界面活性剤、消泡剤、現像を促進さ せるための少量の有機溶剤を含ませてもよい。

てのようにして画像を形成したのち、硬化画像 をマスク材として露出した導電体層をエッチング

(24)

カリ性水溶液である場合はこれよりも強アルカリであるアルカリ性水溶液(たとえば2~7 重量光程度の水酸化ナトリウム水溶液など)によつて除去することにより、絶縁ペース上にパターン化等電体層またはパターン化メッキ層が精密に形成されてなる回路基板が得られる。

#### [発明の効果]

以上のように、との発明においては、透明支持体上に設ける感光性機脂層中に前記式(I)で表わされる特定の化合物を含ませるようにしたことになり、 面像を形成するべき基板における導電体層の 表面組さが1 一以下となるような場合でもとが優化の現像をきたれて、 エッチングなり の回像形成処理工程中に使い面像形成が割を でいることができる。したがつて、 この面像形成材 を 付は、 液晶表示装置やエレクトロクロミック表示 装置などの特密な回路形成が要求される用途などに対しても有利に応用することができる。

〔実 施 例〕

以下に、との発明の実施例を記載してより具体 的に説明する。なお、以下において部とあるは重 量部を意味するものである。

#### 奥施例1

スチレン - マレイン酸イソプロピル 半エステル共重合体 (日本触媒化学工業社製の商品名 SH 101 ;重量平均分子量 9,000)	100部
2・2-ビス(4-メタクリロキシポリエトキシフエニル)プロペン(新中村化学工業社製の商品名BPB-500)	100部
2・4-ジエチルチオキサントン	8部
pージメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル	3 🕸

2 #8

4 · 4' · 4'-メチリデイン-トリス (N·N-ジエチル-3-メチルベンゼンアミン) ピクトリアピユアーブルー 0.08 163

0.04部 ハイドロキノン

上記の組成物を酢酸エチルに均一に溶解混合し て、固型分譲度が40重量%となる光重合性組成 物格液を調製した。この溶液を、透明支持体とし ての25四厚の透明なポリエチレンテレフタレー トフィルム上にアプリケータにより盤布し、80℃ で5分間加熱乾燥を行つて約25㎞厚の感光性樹

(27)

層をエッチング除去した。その後、10分間水洗 したのち、100℃の熱風乾燥機にて加熱乾燥し た。このエッチング処理および水洗処理中、硬化 画像は剝がれることなく非常に良好な耐性を示し 1:0

最後に、3重量%の水酸化ナトリウム水溶液に て処理して硬化画像を除去し、さらに水洗乾燥す ることにより、絶縁ペース上にパターン化導電体 層を有する回路板を得た。このときの硬化画像の 除去性は良好で、上記水溶液によつて簡単にかつ 完全に除去できた。

#### 比較例1

感光性樹脂層を形成するための組成物中に 4・  $4 \cdot 4 - x + y + y + x - y + y = 0$ ルー3-メチルペンゼンアミン)2部を配合しな かつた以外は、実施例1と間様にして画像形成材 料を得、てれを用いて実施例1と同様にして現像 および回路形成を試みた。その結果、現像につい ては実施例1とほとんど変わらなかつたが、エッ チング処理後水洗する際に硬化画像が剝がれてし

(29)

脂層を形成し、この発明の国像形成材料とした。

つぎに、この画像形成材料を、絶様ベースとし ての厚み125戸の透明なポリエチレンテレフタ レートフイルム上に導電体層として厚み200A の酸化インジウムー酸化スズ複合膜を形成してな る500Ω/23タイプの透明導電性フイルムから なる基板の上記導配体層の表面に、感光性樹脂層 側が内側となるように90℃の条件下で加熱圧着 して積層した。

この積層体の透明支持体の表面に陰画原稿を密 着させ、この原稿を通して3kWの超高圧水銀燈に より光源から60㎝の距離で20秒間篙光した。 その後、透明支持体を銅離したのち、1重量%の **炭酸ナトリウム (Na, CO<sub>2</sub>)水溶液中に25℃下で** 3 分間揺動浸液して現像することにより、終幅75 無までの解像度を有する鮮明な画像が得られた。

ついで、この硬化関係を有する基板を、りん酸 : 硝酸: 酢酸: 水の容積比が20:1:0.5:7 の混合水溶液からなるエッチング液に30秒間浸 潰し、硬化画像をマスク材として露出する導電体

28

まつた。

# 実施例2

感光性樹脂層を形成するための組成物における 2・4-ジェチルチオキサントン8部および4・ 4 · 4 - × チリデインートリス(N·N - ジエチ ルー3ーメチルベンゼンアミン)2部の代わりに、 2 · 2 - ジメトキシ - 2 - フエニルアセトフエノ ン(光重合開始剤)4部および4・4・4ーメチ リデイン~トリス(N・N-ジメチルペンゼンア ミン)5部を用いた以外は、実施例1と同様にし て画像形成材料を得、これを用いて実施例1と問 様にして現像および回路形成を試みた。その結果、 現像段階では線幅125㎞までの解像度を有する 鮮明な画像を形成でき、また回路形成のためのエ ッチング処理やその後の水洗処理中、硬化画像は 剣がれることなく良好な耐性を示し、最終的に絶 緑ペース上に鮮明なパターン化導電体層を有する 回路板を得ることができた。

#### 比較例2

感光性樹脂圏を形成するための組成物中に 4・

4・4・メチリディン・トリス(N・N・ジノチルベンゼンアミン)5 部を配合しなかつた以外は、 実施例2と同様にして面像形成材料を得、これを 用いて実施例1と同様にして現像および回路形成 を試みた。その結果、現像については実施例2と ほとんど変わらなかつたが、回路形成のためのエ ッチング処理中に硬化面像が剝がれてしまった。

#### 実施例3

ハイドロキノン

スチレン-マレイン酸ブチルセロソルブ 半エステル共重合体(荒川化学工象社 製の商品名KU-200;重量平均分 子登11万)	100部
東亜合成化学社製の商品名アロニツクス M-5700(2-ヒドロキシー3-フエノキシ プロピルアクリレート)	100部
2 -イソプロピルチオキサントン	10部
4・4'・4'-メチリデインートリス(N・N -ジメチルー3 -エチルベンゼンアミン)	5 郵
ピクトリアピユアーブルー	0.08部

感光性樹脂層を形成するための組成物として上 記の組成物を用いるようにした以外は、実施例1 と同様にして画像形成材料を得、これを用いて実 施例1と同様にして現像および回路形成を試みた。 その結果、現像段階では瞭幅100 mまでの解像 度を有する鮮明な関像を形成でき、また回路形成 のためのエッチング処理やその後の水洗処理中、 硬化画像は剣がれることなく良好な耐性を示し、 最終的に絶縁ベース上に鮮明なパターン化導電体 層を有する回路板を得ることができた。

#### 比較例3

感光性樹脂層を形成するための組成物中に4・4・4・メチリデインートリス(N・N・ジメチルー3ーエチルペンゼンアミン)5部を配合しなかつた以外は、実施例3と同様にして画像形成材料を得、これを用いて実施例1と同様にして現像および回路形成を試みた。その結果、現像については実施例3とほとんど変わらなかつたが、回路形成のためのエッチング処理中に硬化画像が流出し剝がれてしまつた。

特許出願人 日東電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 袮宜元 邦 夫



(31)

0.04部